二酸化炭素を用いた優しい酸化雰囲気での

レーザ蒸着法による成膜

地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所 電子技術部 グループリーダー 金子 智 (平成 29 年度 一般研究開発助成 AF-2017219)

キーワード:機能性材料,レーザ蒸着,二酸化炭素

1. 研究の目的と背景

酸化物の成膜では酸素欠損を防ぐために酸素雰囲気で の成膜がスパッター法やパルスレーザー蒸着法で行われ ている。ダイアモンドの成長なども酸化雰囲気中でのレー ザー蒸着(PLD)法の報告がある¹⁾。同じ炭素系材料である グラフェンは、シリコンの100倍の移動度や鉄鋼の200倍 の強度を示すことで様々な応用が期待されている。その薄 膜化には触媒が必要であり、高い成膜温度も必要である。 著者らは酸素雰囲気でのグラフェン成長を試みたが、平坦 な膜の成長は確認できなかった。

人の呼気にも含まれる二酸化炭素は安定なガスと思わ れるが、古くから酸化剤として働くことも知られている。 1864年の論文²⁾が著者らが見つけた最古の出版物である。 二酸化炭素は基板温度の制御により、酸化剤として振る舞 うことで「優しい酸化雰囲気」を提供する。これまでに、 酸素雰囲気中での各種機能性材料の合成を行っている

表 | レーザー蒸着法による成膜条件

雰囲気ガス	酸素	~400 mTorr
	窒素	400 mTorr
	二酸化炭素	~400 mTorr
レーザー波長	266 nm	
繰り返し周波数	2 Hz*	
エネルギー密度	~ 2 J/cm ²	
ターゲット	MgO, HOPG (highly oriented pyrolytic graphite)	
基板間距離	20 ~ 30 mm	
基板	Si, MgO, Sapphire, SrTiO	
基板温度	R.T. ~ 750°C	
成膜時間	HOPG	~30 min
	MgO	~30 min

^{3.4.5)}が、本研究では酸素に代わり二酸化炭素を用いる成膜 法により、グラフェンの成長を試みている。更に、炭素系 膜だけではなく、「優しい酸化雰囲気」での酸化マグネシ ウム(MgO)の合成も目指した。酸素雰囲気での MgO の格子 定数の収縮を確認している。酸素雰囲気での格子収縮につ いては、第一原理計算により欠陥による影響を指摘してい る⁴⁾。本研究では、二酸化炭素による「優しい酸化雰囲気」 での成膜を行い、更に、東北大大学流体研究所との共同研 究により、各種機能性材料の成長における安定性について、 理論的な考察を進めている。

2. 実験方法

2・1 成膜の概要

図1に、実験に用いた PLD 成膜装置の概要を示した。本 実験では、酸素・窒素・二酸化炭素をそれぞれチャンバー に導入して各種雰囲気での成膜を行った。レーザー光源に は YAG レーザーの 4 倍波 (266nm)を繰り返し周波数 2Hz で 用いている。YAG レーザーのオシレーターの発振は 10Hz



図1 レーザー蒸着法による成膜。 酸素、窒素、二酸化炭素中での成膜を行った。



図 2 AFM による表面粗さ。基板はそれぞれ (a) シリコン (b) サファイア (c) 酸化マグネシウム (d) チタン酸ストロンチウムである。

であるが、レーザー蒸着に十分なレーザー強度を得るため に、Q スイッチを 2Hz で同期する Slower-Qswitch 法を用 いている⁶⁾。炭素系材料成膜の基板として、チタン酸スト ロンチウム(SrTiO₃)、酸化マグネシウム(MgO)とシリコン (Si)基板を、MgO 成膜には Si 基板のみを用いた。表1に 各種実験条件を示している。

成膜後は、リガクのUltimaIVとSmartLabを用いたX線 回折によりMgO膜の結晶性と配向性を評価し、X線反射率 測定(XRR)により膜厚を評価した。また、面内配向の評価 には図2に示すようなインプレーン XRD 測定を用いてい る。炭素系膜につてはラマン測定により評価を行い、原子 間力顕微鏡(AFM)により表面形態を観察した。

2・2 シミュレーションの概要

シリコン基板上での Mg0 と炭素の六員環の安定性を密 度汎関数法を用いて吸着エネルギーで評価している。シミ ュレーションは東北大学流体研究所より、ソフトウエアパ ッケージである DMo13 を用いて行なった。Mg0 の分子モデ ルは Material Studio を用いて構築し、GGA 法で計算を行 なっている⁷⁾。

欠陥による Mg0 の格子定数の変化については、GNU によ り配布されている abinit (URL:www.abinit.org)を用いて、 LDA 及び GGA を用いた格子の最適化を行っている⁴⁾。ソー スコードから abinit と OpemPMI (URL:www.open-mpi.org) のコンパイルを行い、MacOS 上の Darwin で並列処理によ り計算を行なった。

3. 結果と考察

3·1 炭素系膜

二酸化炭素での「優しい酸化雰囲気」ではチタン酸スト

ロンチウム(SrTiO₃)上でグラフェンが1層づつ成長(レー ヤー・バイ・レイヤー成長)することを報告している。更 に、基板として、シリコン・MgO・サファイアを用いて成 膜を行い、その表面のAFM像を図2に示す。SrTiO基板上



図3 二酸化炭素中で成長したグラフェンのラマンスペ クトル。



図4 原子間力顕微鏡像(AFM)。二酸化炭素中で120秒の 堆積時間の試料の表面。

(a) surface normal

(b) out of plane



図5 X線回折評価。(a)面垂直方向、(b)面内の $\theta - 2\theta$ 法のスペクトル。赤点線はバルク材の ピークの位置を示す。

では平坦な膜表面がその他の基板上では平坦性が保たれていない。SrTiO₃上ではRa[~]0.3 nmの表面粗さが、サファイア、MgO、Si 基板のそれぞれでRa が、6,4,4 nmを示した。特にSi 基板上ではボール状に成長しているが、ボール状成長は玉ねぎ状に炭素が成長しているとの報告もある⁹。



図6 MgO 結晶の面内配向性。基板格子に対して 45 度回 転する場合と cubic on cubic 成長がある。



図7 シリコン基板上での MgO 結晶の安定性。シリコン基 板上での吸着エネルギーを示す。

フラットな表面を示した SrTiO₃ 基板上に成長した膜の ラマンスペクトルを図3に示す。炭素原子の平面内運動に 由来する 1580 cm-1 のGバンド、構造の乱れと欠陥に起 因する 1300[~]1400 程度に現れる D バンド (disorder band)、そして、G'(G プライム)とも呼ばれる2二次の二 フォノン散乱によるピークが確認された。測定には励起光 源として 750nm を用いたため、高波数側での検出器の感度 を補正している。米国の National Institute of Science and Technology (NIST)から提供されている標準試料 (Standard Reference Materials (SRM) 2241)用いて補正 は行われた⁸⁾。

平坦な表面を持つ膜が成長する SrTi0₃上での成膜では、 ステップ基板を用いた場合、60 秒でまた表面が平坦にな ることが AFM により観察され、1 層づつ成長(laer by layer 成長)が確認された。2D フーリエ変換を用いた 60 秒 成膜後の表面の AFM 像からはグラフェンの六員環が確認 できる(図4)。

各種基板上での炭素材料の安定性を DMo13 によって検 討した。1 個の六員環で検討を始めたが、周期境界で六員 環が安定せず、大きな周期条件が必要になることが分かっ た。現在、周期条件と六員環モデルの大きさ、終端などに ついての検討を行っている。

3・2 酸化マグネシウム(Mg0)膜

グラフェンやシリコンカーバイドなどの基板上での成 長をシミュレーションで評価することを東北大学流体研 究所と検討している。まずはじめにシンプルな系として、 面心立法格子をもつ酸化マグネシウム(MgO)のシリコン基 板上での安定性について評価した。

酸素雰囲気でシリコン基板上に成長した MgO は X 線回 折θ-2θ法による基板垂直方向と面内評価により、図5に 示すように単結晶成長していることが分かった。しかし、 通常のバルクと比較して、Mg0のピークが高角度側にシフ トしている。これは、シリコン基板上に成長した Mg0の格 子定数が縮んでいることを示している。



図8 二酸化炭素雰囲気で成長した MgO 薄膜の XRD スペ クトル三枝雰囲気と同様にピークの高角度下側へのシフ トが確認できる。

Mg0 の面内配向性は、図6のように 45 度回転か cubic on cubic 成長するが、シリコン格子に対して 45 度回転す る報告が多い。しかし、今回の結果からは、Mg0 は回転し ておらず、cubic on cubic 成長していることも分かった。 そこで、シリコン基板上での Mg0 の安定性を評価するため に、密度汎関数法を用いてシリコン基板上での Mg0 の吸着 エネルギーを見積もってみた。その結果を図7に示した。 cubic on cubic 成長の方が安定している結果となり、実 験結果と一致することが分かった。

更に、二酸化炭素中でシリコン基板上への Mg0 薄膜を成 膜したところ、酸素雰囲気に比較して二酸化炭素中では広 い範囲で Mg0 が多結晶として結晶成長するがことが分か った。一例として、二酸化炭素雰囲気 160 mTorr、基板温 度 750 度で 30 分の成膜を行なった Mg0 薄膜の XRD スペク トルを図 8 として示す。二酸化炭素中で成膜された Mg0 薄 膜の Mg0(111)と Mg0(002)のピークも、酸素雰囲気での成 長と同様に高角度側にシフトしていることが確認できた。 また、これら 2 つのピークから、Mg0 の格子定数は、4.15Å と見積もれる。

欠陥モデルでの密度汎関数計算では擬ポテンシャル法 による評価により、MgO格子の収縮を報告している。酸素 欠損でも、酸素過多であっても格子定数は伸長する。金属 原子についても同様に格子定数は伸びることが分かって いて、Mg と酸素のペアで抜けていく時に格子は収縮する ことを報告している。現在は、PAW(projector augmented wave method)法による欠陥モデルでの格子定数の最適化 を進めている。効率敵な計算手法により、より大きな supercell での計算が実用的な時間で可能になると期待 される。

謝 辞

本研究は、公益財団法人天田財団の研究助成金(AF-2017219)により実施したことを付記して謝意を表します。 本研究内容は、同じく天田財団の国際会議等参加助成を受 け、オーストラリア・パースで開催された国際材料学会 (Internatinal Union of Materials Research Societies - International Conference in Asia, IUMRS-ICA2019) でのシンポジウム運営と招待講演を行いました。また、理 論計算では東北大学流体研究所の公募型共同研究事業 (J19L016, J201071)の助成を受けています。

参考文献

- M. Yoshimoto, K. Yoshida, H. Maruta, Y. Hishitani, H. Koinuma, S. Nishio, M. Kakihara, T. Tachibana : Nature, 340 (1999), 399.
- 2)M. H. S. Deville :Compt. Rend., 873 (1864), 59.
- 3)S. Kaneko, K. Akiyama, H. Funakubo, M. Yoshimoto : Phys. Rev. B, 054503 (2006), 74.
- 4) S. Kaneko, T. Nagano, K. Akiyama, T. Ito, M. Yasui, Y. Hirabayashi, H. Funakubo, M. Yoshimoto : J. Appl. Phys., 073523 (2010), 107.
- 5)S. Kaneko, H. Torii, M. Soga, K. Akiyama, M. Iwaya, M. Yoshimoto, T. Amazawa : Jpn. J. Appl. Phys., 01AC02 (2012), 51.
- 6)S. Kaneko and Y. Shimizu and S. Ohya : Jpn. J. Appl. Phys., 4870 (2001), 40.
- 7) S. Kaneko, T. Tokumasu, Y. Nakamaru, C. Kokubun, K. Konda, M. Yasui, M. Kurouchi, M. Can, S. Shawuti, R. Sudo, T. Endo, S. Yasuhara, A. Matsuda, M. Yoshimoto : J. Appl. Phys., SAAD06 (2019), 58.
- 8)S. Kaneko, T. Ito, C. Kato, S. Tanaka, S. Yasuhara, A. Matsuda, M. Yoshimoto : ACS Omega, 1523 (2017), 2
- 9) W. C. Yen, Y. Z. Chen, C. H. Yeh, J. H. He, P. W. Chiu, andY. L. Chueh : Scientific Report 4739, (2014), 4.